



第四章 測邊

內容

- 4.1 前言
- 4.2 拉普拉斯算子
- 4.3 Marr-Hildreth算子
- 4.4 基底投射法
- 4.5 輪廓追蹤法

4.1 前言

- 介紹前置處理(Preprocessing)中的測邊(Edge Detection)技巧。

4.2 拉普拉斯算子

對 $f(x, y)$ 沿 x 軸差分：

$$\nabla_x f = f(x+1, y) - f(x, y)$$

再對 x 軸差分得：

$$\begin{aligned}\nabla_x^2 f &= f(x+2, y) - f(x+1, y) - [f(x+1, y) - f(x, y)] \\ &= f(x+2, y) - 2f(x+1, y) + f(x, y)\end{aligned}$$

令 $x=x+1$ ，可得：

$$\nabla_x^2 f = f(x+1, y) - 2f(x, y) + f(x-1, y)$$

同理，沿著 y 軸差分二次得：

$$\nabla_y^2 f = f(x, y+1) - 2f(x, y) + f(x, y-1)$$

合併可得拉普拉斯算子：

$$\begin{aligned}\nabla^2 f &= \nabla_x^2 f + \nabla_y^2 f \\ &= f(x, y+1) + f(x+1, y) + f(x, y-1) + f(x-1, y) - 4f(x, y)\end{aligned}\tag{4.2.1}$$

- 圖4.2.5面罩的數學背景來源為式(4.2.1)

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

圖4.2.5 拉普拉斯測邊算子

- 使用拉普拉斯算子來測邊：

如果能滿足 $\nabla^2 f(x-1, y)$ 和 $\nabla^2 f(x+1, y)$ 的值呈現一個是正數另一個為負數，且 $|\nabla^2 f(x+1, y) - \nabla^2 f(x-1, y)|$ 大於門檻值 T 的情況，我們就宣稱 (x, y) 的位置上有一個邊點。

相同的，若是 $\nabla^2 f(x, y-1)$ 和 $\nabla^2 f(x, y+1)$ 滿足上述條件，我們也可以將位置 (x, y) 上的像素視為一個邊點。

通過零點(Zero-crossing)

- 主要觀念:灰階的突然變化(Abrupt Change)。
- 一次微分後形成的波峰(Peak)超過門檻值(Threshold)，有邊點形成。
- 二次微分:通過零點(Zero Crossing)觀念。

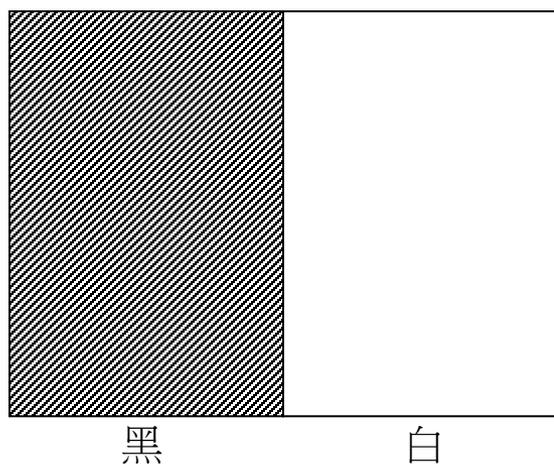


圖4.2.1
兩個同質但不同色的區域

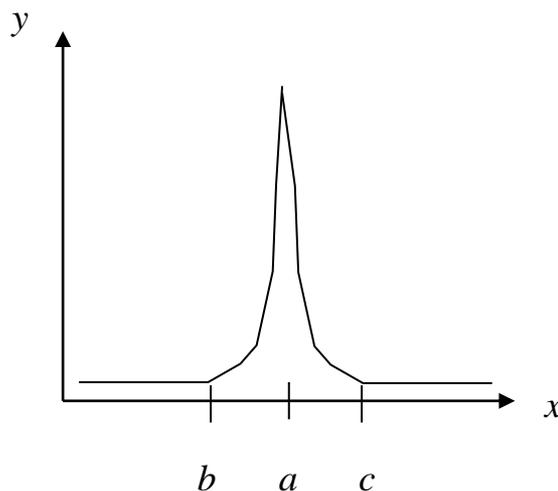


圖4.2.2
圖4.2.1的一次微分結果

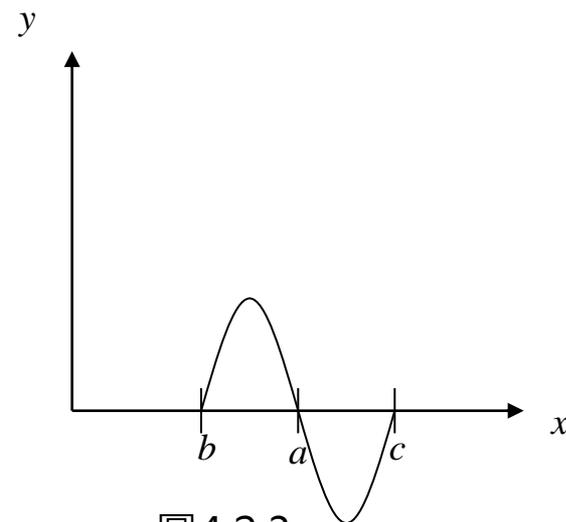


圖4.2.3
通過零點示意圖

- 通過零點的另一個示意圖。

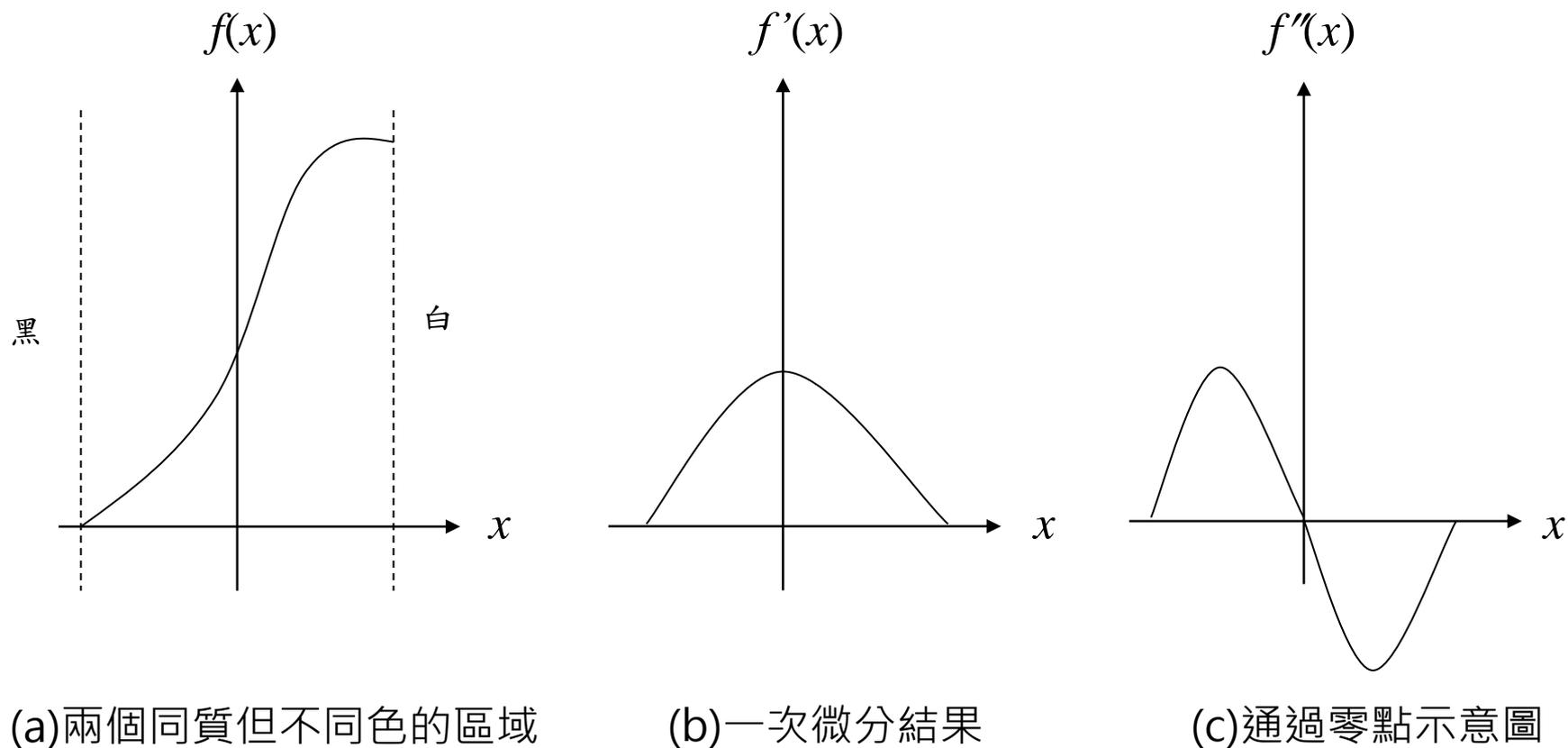


圖4.2.4 通過零點的另一個示意圖

Sobel測邊算子

- Sobel測邊算子，其對應的面罩有兩個，一個為 x 方向，另一個為 y 方向。
- 從 $\nabla_x f$ 和 $\nabla_y f$ 的兩個分量，我們可知合成的量(Magnitude)為

$$\sqrt{(\nabla_x f)^2 + (\nabla_y f)^2}$$

而角度為 $\theta = \tan^{-1} \frac{\nabla_y f}{\nabla_x f}$ 。

- 為了計算更快速，以 $|\nabla_x f| + |\nabla_y f|$ 的運算取代 $\sqrt{(\nabla_x f)^2 + (\nabla_y f)^2}$ 的運算。
- 另外有一個很類似Sobel測邊算子的方法 - Prewitt算子。

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

(a) 測 y 方向的灰階變化 (b) 測 x 方向的灰階變化

圖4.2.8 Sobel測邊算子

-1	-1	-1
0	0	0
1	1	1

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

(a) 測 y 方向的灰階變化 (b) 測 x 方向的灰階變化

圖4.2.9 Prewitt算子

範例3：給一如下的 5×5 子影像，請使用Prewitt算子來測邊，這裡假設門檻值 T 為78。

15	39	42	27	12
12	21	48	15	9
9	21	27	12	3
18	15	33	18	18
45	60	57	24	21

解答：

	(1)	(2)	(3)	
	(4)	(5)	(6)	
	(7)	(8)	(9)	

圖4.2.10(a)
為使用Prewitt算子得到的相關資訊

圖4.2.10(b)利用Prewitt算子得到的結果

$\nabla_x f$	$\nabla_y f$	$ \nabla_x f + \nabla_y f $
(1) $-6-18-15=-39$	$27+36+18=81$	$39+81 = 120 > T$
(2) $18+15+15=48$	$-12-6-24=-27$	$48+27 = 75$
(3) $15+15+9=39$	$-30-39-24=-93$	$39+93 = 132 > T$
(4) $-6+6+15=15$	$36+18+15=69$	$15+69 = 84 > T$
(5) $6+15-3=18$	$-6-9+3=-12$	$18+12 = 30$
(6) $-15+3+9=-3$	$-39-24-15=-78$	$3+78 = 81 > T$
(7) $36+39+30=105$	$18+15+12=45$	$105+45 = 150 > T$
(8) $39+30+12=81$	$-9+3-36=-42$	$81+42 = 123 > T$
(9) $30+12+18=60$	$-24-15-36=-75$	$60+75 = 135 > T$

從圖4.2.10中可得知像素(1)、(3)、(4)、(6)、(7)、(8)和(9)皆為邊點，所以最後測邊結果為一個如下的倒U字型。

	X		X	
	X		X	
	X	X	X	

解答完畢

4.3 Marr-Hildreth算子

- Marr-Hildreth測邊算子結合了高斯平滑算子和拉普拉斯算子的雙重技巧。
- 高斯平滑算子(Gaussian Smoothing Operator) :

$$G(x, y) = e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} \quad (4.3.1)$$

- LOG (Laplacian of Gaussian) :

$$LOG = \nabla^2 [G(x, y, \sigma) * f(x, y)] \quad (4.3.2)$$

* 表迴積運算，而 ∇^2 表拉普拉斯算子。

→
結合性

$$LOG = [\nabla^2 G(x, y, \sigma)] * f(x, y) \quad (4.3.3)$$

令 $r^2 = x^2 + y^2$ ，則 $G(x, y, \sigma) = e^{\frac{-r^2}{2\sigma^2}}$ ，對 x 微分一次，得 $\frac{\partial G}{\partial x} = \frac{-x}{\sigma^2} e^{\frac{-r^2}{2\sigma^2}}$

再對 x 微分一次，得 $\frac{\partial^2 G}{\partial x^2} = -\frac{1}{\sigma^2} e^{\frac{-r^2}{2\sigma^2}} + \left(-\frac{x}{\sigma^2}\right)\left(-\frac{x}{\sigma^2}\right) e^{\frac{-r^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sigma^2} \left(\frac{x^2 - \sigma^2}{\sigma^2}\right) e^{\frac{-r^2}{2\sigma^2}}$

同理，我們可推得 $\frac{\partial G}{\partial y} = \frac{-y}{\sigma^2} e^{\frac{-r^2}{2\sigma^2}}$ $\frac{\partial^2 G}{\partial y^2} = \frac{1}{\sigma^2} \left(\frac{y^2 - \sigma^2}{\sigma^2}\right) e^{\frac{-r^2}{2\sigma^2}}$

綜合以上推演，可得 $\nabla^2 G(x, y, \sigma) = \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 G}{\partial y^2} = \frac{1}{\sigma^2} \left(\frac{x^2 + y^2 - 2\sigma^2}{\sigma^2}\right) e^{\frac{-r^2}{2\sigma^2}}$

代入式子(4.3.3)，可得 $LOG = \frac{1}{\sigma^2} \left(\frac{x^2 + y^2}{\sigma^2} - 2\right) e^{\frac{-r^2}{2\sigma^2}} * f(x, y)$

為得到一個面罩且其面罩內的加權和為零，
我們令 LOG 的面罩形式如下所示，這裡的常數 c 是用來正規化用的。

$$LOG = c \left(\frac{x^2 + y^2 - 2\sigma^2}{\sigma^4}\right) e^{\frac{-(x^2 + y^2)}{2\sigma^2}}$$

範例1：可否對式(4.3.4)多做解釋？

解答：

假設面罩大小為 5×5 ，各像素的位置定義如下：

(-2,2)	(-1,2)	(0,2)	(1,2)	(2,2)
(-2,1)	(-1,1)	(0,1)	(1,1)	(2,1)
(-2,0)	(-1,0)	(0,0)	(1,0)	(2,0)
(-2,-1)	(-1,-1)	(0,-1)	(1,-1)	(2,-1)
(-2,-2)	(-1,-2)	(0,-2)	(1,-2)	(2,-2)

將面罩內25個位置座標代入 (x, y) 內

$$\frac{x^2 + y^2 - 2\sigma^2}{\sigma^4} e^{-\frac{(x^2 + y^2)}{2\sigma^2}}$$

*	*	O	*	*
*	O	x	O	*
O	x	Δ	x	O
*	O	x	O	*
*	*	O	*	*

上面的分類中，打 * 號的值為趨近於零;打 Δ 、x、和 O 號的值都不大，但是以 16 : -2 : -1 的比例呈現。

解答完畢

正規化後則可得下列面罩：

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 16 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (4.3.4)$$



圖4.3.1 測試影像



圖4.3.2 利用Marr-Hildreth算子測邊後的結果

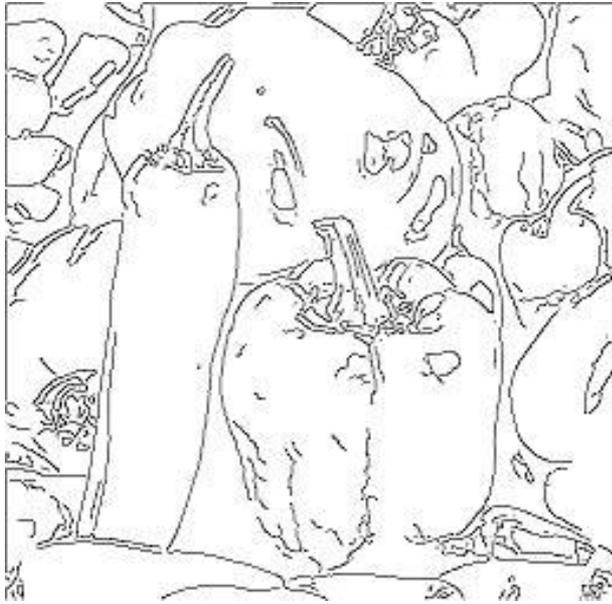


圖4.3.3 利用Canny測邊法所得到的邊圖(Edge Map)

- Canny首先利用高斯平滑算子去除過多的細紋，然後在每個像素上計算其梯度方向和梯度量。假若在這梯度方向上，該像素的梯度量大於二個鄰居的量，則該像素為邊點，否則為非邊點。較弱的邊點可利用磁滯(Hysteresis)門檻化予以去除。

4.4 基底投射法

- 在圖4.4.1中任挑二個不同向量，皆可檢定出內積為零，從而知道這九個向量兩兩為正交的。

- 令圖4.4.1中的九個向量分

為 v_1 、 v_2 、...和 v_9 ，

則 $w_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}$ 、 $w_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|}$ 、...

$w_9 = \frac{v_9}{\|v_9\|}$ 和可另外構成一

組正交且單位化的基底。

1	$\sqrt{2}$	1
0	0	0
-1	$-\sqrt{2}$	-1

(a)

1	0	-1
$\sqrt{2}$	0	$-\sqrt{2}$
1	0	-1

(b)

0	-1	$-\sqrt{2}$
1	0	-1
$\sqrt{2}$	1	0

(c)

$\sqrt{2}$	-1	0
-1	0	1
0	1	$-\sqrt{2}$

(d)

0	1	0
-1	0	-1
0	1	0

(e)

-1	0	1
0	0	0
1	0	-1

(f)

1	-2	1
-2	4	-2
1	-2	1

(g)

-2	1	-2
1	4	1
-2	1	-2

(h)

1	1	1
1	1	1
1	1	1

(i)

圖4.4.1 基底

- 視窗所框住的 3×3 子影像，依列優先(Row Major Order)的順序得向量 $z = (z_1, z_2, \dots, z_9)^t$ 。對上述九個正交且單位化的基底投影，可得 $m_1 = z^t \cdot w_1$ 、 $m_2 = z^t \cdot w_2$ 、... 和 $m_9 = z^t \cdot w_9$ 。令

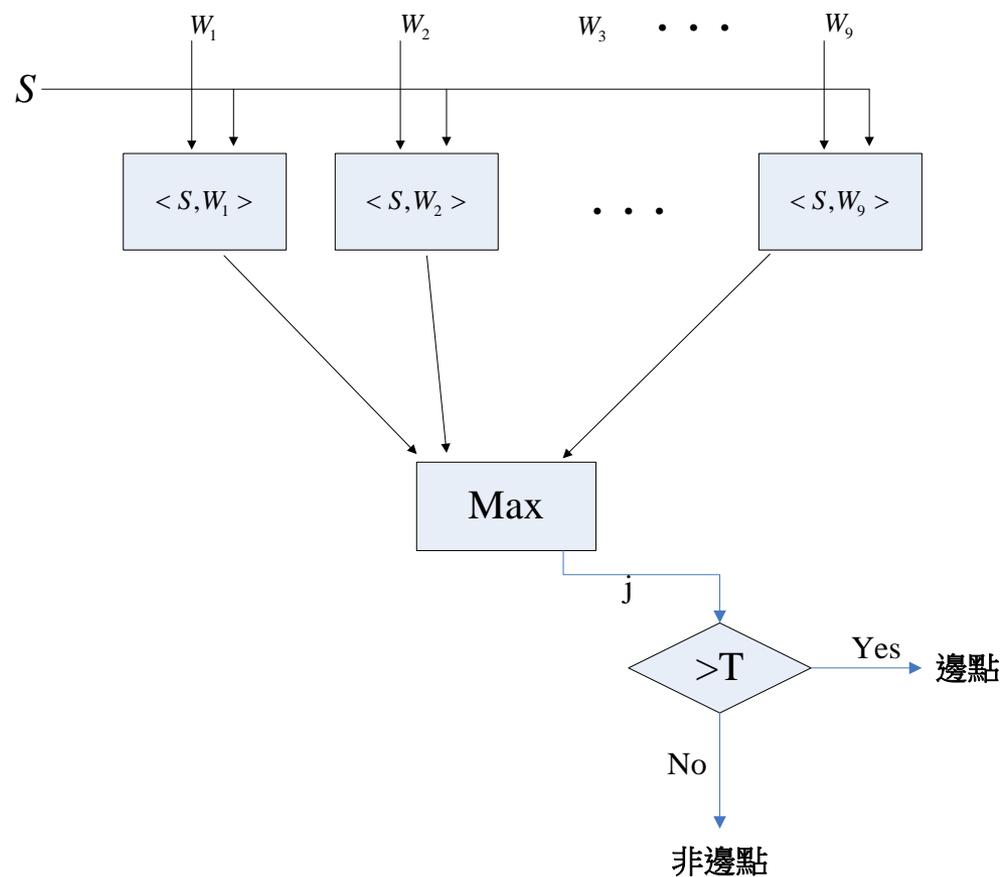
$$m = \max\{m_1, m_2, \dots, m_9\}$$

假設 m 對應的基底之向量為圖4.4.1(a)，則代表有水平紋理邊點。若對應的為圖4.4.1(i)，則表 z 在平滑區域。

- 實作時，引入門檻值，依迴積方式進行。
- 缺點:有些基底向量的意義不明確。

範例1：以上的九個基底向量為何要化成單位正交向量？可否給一個示意圖以明示基底投射法的觀念？

解答：



解答完畢

4.5 輪廓追蹤法

- 在物體邊緣外側邊緣標識一圈控制點集(可利用雲形曲線集)。

- 能量函數 $E = \int (\alpha(t)E_{cont} + \beta(t)E_{curv} + \gamma(t)E_{image})dt$ (4.5.1)

$$E_{cont} = \left\| \frac{dc(t)}{dt} \right\|^2 = \|b_i - b_{i-1}\|^2 \quad \rightarrow \text{微分一次後連續項能量}$$

$$E_{curv} = \left\| \frac{d^2c(t)}{dt^2} \right\|^2 = \|b_{i-1} - 2b_i + b_{i+1}\|^2 \quad \rightarrow \text{微分二次後平滑項能量}$$

$$E_{image} = -\|\nabla I\| \quad \rightarrow \text{輪廓受到往影像邊點處的拉力}$$

$c(t)$ 為影像中初步用雲形曲線框住的輪廓且輪廓上構成的點為 b_1 、 b_2 、 b_3 ... 和 b_n 。通常 α_i 、 β_i 和 γ_i 可定為 1，但是若碰到角點(Corner Point)時， β_i 可定為 0。

- 正規化能量項：

E_{curv} 和 E_{cont} 可除以視窗內相關能量的最大值。

E_{image} 中的 $\|\nabla I\|$ 可改為 $\frac{\|\nabla I\| - m}{M - m}$ ，這裡 m 代表鄰近 $\|\nabla I\|$ 的最小值，而 M 代表鄰近 $\|\nabla I\|$ 的最大值。

- 從 b_1 出發，首先以 3×3 視窗將點 b_1 框住，針對視窗內的每一點計算其能量。移往能量和所得為最小的點。直到 n 個點都處理完。不斷地進行疊代直到輪廓不再改變為止。

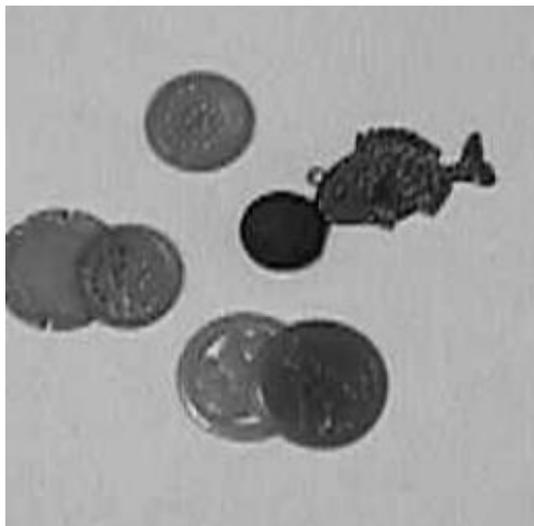


圖4.5.1 輸入的影像

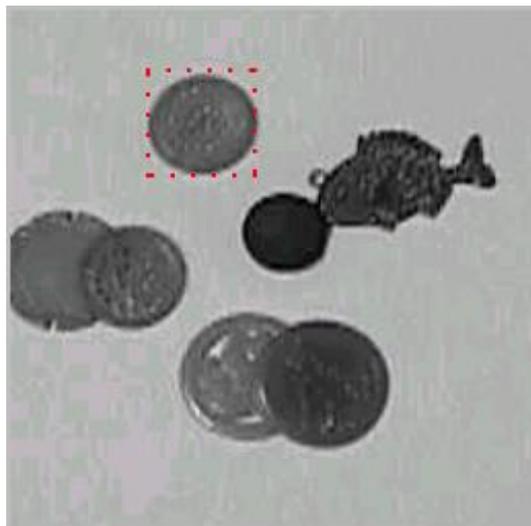


圖4.5.2 初始輪廓

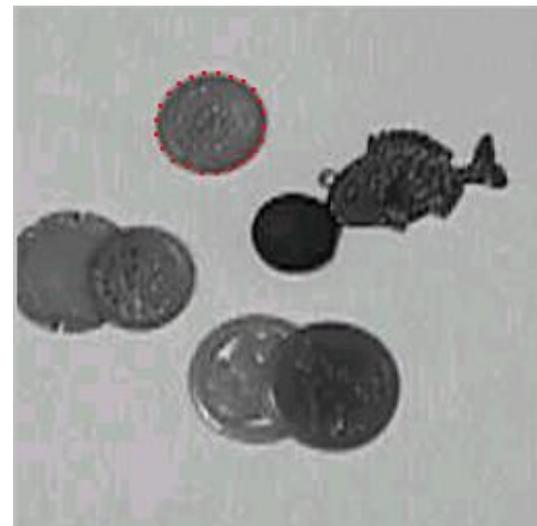


圖4.5.3 最終所找到的輪廓